

(مانده از شماره قبل)

بحثی درباره شیمی جامدات

نوشته :

نورالدین حبیبی

دانشکده فنی

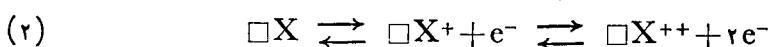
دکتر مهندس در شیمی

ترکیبات غیر استوکیومتریک Composés non stoechiometrique

در قسمت قبل تعریف و چگونگی پیدایش ترکیبات غیرستوکیومتریک بیان گردید و اثر غیرستوکیومتریک بر روی بعضی از خواص این قبیل ترکیبات مطالعه شد. اینکه دنباله مطلب را در مورد *Défauts* و انواع مختلف آن بیان میکنیم :

Défauts ایونیزاسیون .

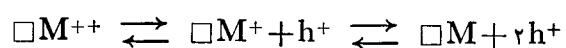
۱ - در حالیکه *Défauts* خنثی میباشد : فعل و افعالات زیر ایونیزاسیون lacunes کاتیونیک و آنیونیک را روشن میسازد :



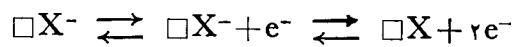
در مورد *M* و *X* که در فضای ملکولی داخل شده‌اند (intersticiel) برای :

ادخالی	<i>M</i>	+	<i>e</i> ⁻
»	<i>X</i>	+	<i>h</i> ⁺

۲ - در مورد بلورهای ایونیک *MX* و در حالیکه *M* دو ظرفیتی باشد (*M⁺⁺X⁻⁻*) در صورتیکه *lacune* کاتیونیک باشد ایونیزاسیون آن چنین خواهد بود :



و برای آنیونیک *lacune* :



بعضی از نویسندها lacune یک ایون را مثل یک اتم خنثی میدانند. ولی در صورتیکه وضع قرار گرفتن اتمها در شبکه بلورین برای ایونهای دو ظرفیتی در نظر گرفته شود باید همیشه مراعات با رالکتریکی و تعداد اتمها را کرد.

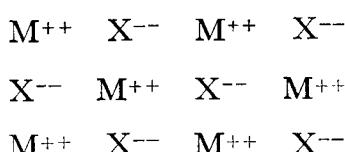
در مورد حالات ۱ و ۲ انحراف از استوکیومتریک را میتوان مانند مراکز دهنده و یا قبول کننده در نظر گرفت در حالات ۱ حفره مشتبث در باند والانس وجود داشته و جسم حاصل نیمه هادی (semi conductur) از نوع p (مشتبث) میباشد.

در حالت ۳ الکترونها در باند کندوکسیون اضافه شده اند و جسم نیمه هادی از تیپ n (منفی) میباشد الکترونها و حفره های مشتبث در شبکه ایونی میتوانند بوسیله تغییر درجه اکسیداسیون توصیف گردد.

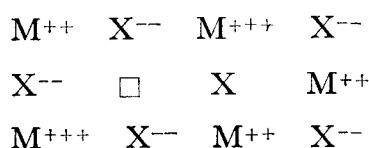
مثال :

در مورد M^{r+} در صورتیکه lacune گاتیونیک تشکیل شود نتیجه منجر با اکسیده شدن دو کاتیون M^{r+} به M^{r+} میگردد (مثلا اکسید فروکه در اثر تشکیل $\square Fe$ lacune منجر به تشکیل اکسید مغناطیسی Fe_3O_4 میگردد) و آنیونیک باعث احیای $2M^{r+}$ به $2M^+$ میگردد.

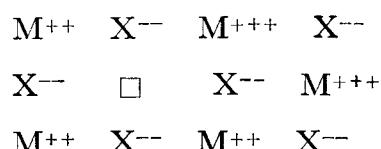
بلور ایونیک ذیل را در نظر میگیریم :



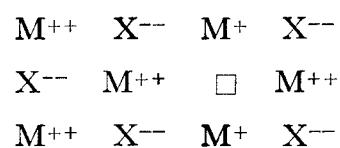
در حالت تشکیل lacune گاتیونیک وضع بلور بصورت زیر بوده و کمپلکس (lacune + trou) تشکیل میگردد.



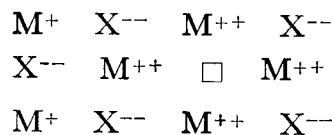
اگر دو گاتیونیکه تحمل بار اضافی را میکنند از یکدیگر دور باشند سروکار با حفره های ایونیزه خواهد بود.



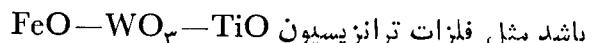
در صورتیکه آنیونیک تشکیل گردد. منجر به ایجاد کمپلکس (lacune + e^- piegé) میگردد و بالنتیجه دو ایون M^{r+} به دو ایون M^+ تبدیل میگردد.



اگر حفره‌ها بر روی دو کاتیونی که از یکدیگر دور می‌باشند حمل شود سروکار بالکترونهای ایونیزه می‌باشد.



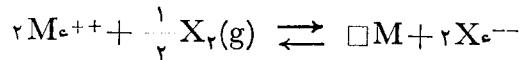
برای اینکه انحراف از استوکیومتری ضعیف باشد بایستی تغییرات انرژی بین دو حالت ظرفیت خیلی ضعیف



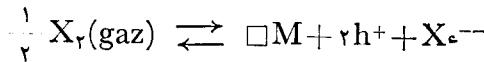
باشد مثل فلزات نرانزیسیون در مورد کریستالهای ایونیک که در آن *Défaut Franckel* وجود دارد (ترکیبی از + اتم ادخالی در شبکه بلورین) ممکن است دو حالت اتفاق افتد:

a - اضافه بودن مقدار آنیون که در اثر M^{++} lacune بوجود می‌آید و پیدایش آنرا بطبق فعل

و انفعال زیر میتوان توجیه کرد:

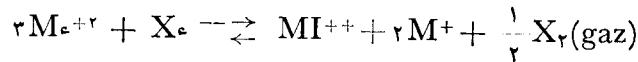


و یا :

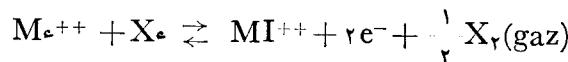


که در آن (ء) وضعیت نرمال ایونها را نشان میدهد.

b - اضافه بودن مقدار کاتیون که ممکن است در اثر ادخال M_I^{++} (M_I^{++}) ایجاد شده باشد:



و یا :



قانون اثر جرم را در مورد تعادلهای فوق مینویسیم:

برای حالت اول:

$$k_1 = pX_2 \cdot \frac{1}{[\square M][h^+]}$$

برای حالت دوم:

$$k_2 = pX_2 \cdot \frac{1}{[MI^{++}][e^-]}$$

برای ترکیبی که نزدیک به استوکیومتریک باشد میتوان در نظر گرفت که:

$$[M^{++}] \simeq [X^{--}] = 1$$

از ضرب نمودن دو رابطه فوق چنین خواهیم داشت:

$$K = k_1 \cdot k_2 \cdot [MI^{++}] \cdot [\square M] \times [e^-] \cdot [h^+]^r$$

در این فرمول فرآکسیون ذاتی : Défaut

$$[MI^{++}] \cdot [\square M] = Ci$$

و

$$[e^-]^r \cdot [h^+]^r = Cte$$

مقدار ثابتی میباشد.

ذیلا این تغییرات را درمورد اکسیدها بررسی می کنیم :

اکسیدها : مطالعه حالات مخصوص که نشان دهنده انحراف از استوکیومتریک میباشد.

۱- اکسید غیر استوکیومتریک که توسط مقدار اضافی فلز تشکیل شده است.

۲- اکسید غیر استوکیومتریک بوسیله کمبود مقدار فلز :

۳- مقدار اضافی M :

این اکسیدها دراثر ثابت شدن M اضافی در فواصل نرمال اتمهای اکسیدها بوجود می آیند و در یک اکسید با فرمول MO بصورت M_I میباشد.

بطوریکه از مدل واگنر استتباط میگردد برای He^{+} در ملکول موجود میگردد که این الکترونهای آزاد باعث هادی شدن جسم میگردند و این هدایت دراثر حرکت این الکترونهاست در صورتیکه x مقدار اضافی فلز نسبت با اکسید استوکیومتریک باشد فرمول اکسید چنین است:

$$(M^{++})_{1+x} e^{-x} O^{--})$$

و درحال تعادل اکسید با گاز اکسیژن چنین خواهیم داشت :

$$k = pO_r^{\frac{1}{2}} [MI^{++}] [e^-]^r$$

و چون غلظت :

$$[e^-] = 2 [MI^{++}]$$

میباشد. در این صورت :

$$\boxed{[e^-] = KpO_r^{-1/2}}$$

و چون هدایت الکتریکی σ اکسید متناسب با غلظت الکترونهای نیمه آزاد میباشد چنین خواهیم داشت :

$$\boxed{\sigma \sim A pO_r^{-1/2}}$$

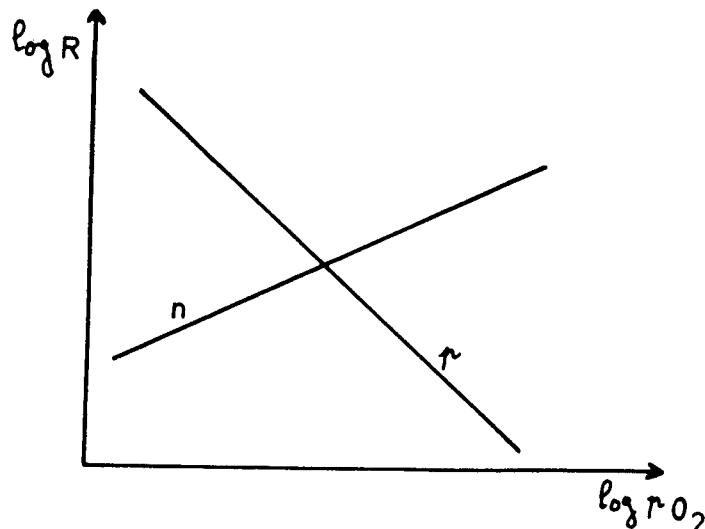
برای اکسیدی با فرمول M_nO_m غیر استوکیومتری و برای مقدار اضافی فلزی هدایت الکتریکی

بر حسب فشار جزئی اکسیژن طبق رابطه زیر تغییر خواهد کرد :

$$\boxed{\sigma \sim A(pO_r)^{-r}}$$

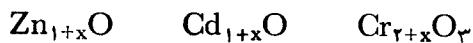
این قبیل اکسیدها نیمه هادی (S.C.) از نوع منفی (n) میباشند. برای این اکسیدها ضریب Hall منفی

و عمل مقاومت الکتریکی چنین اکسیدی با فشار اکسیژن بتوان $r +$ تغییر می‌کند.
در صورتیکه تغییرات لگاریتم مقاومت را بر حسب لگاریتم pO_2 رسم کنیم خط مستقیمی بدست آید که دارای شیب مشتب میباشد.



شکل ۱

اکسیدهای :



اکسید غیراستوکیومتریک از نوع فوق میباشد.

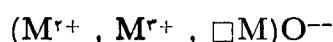
تبصره :

مقدار اضافی فلز ممکن است در نتیجه lacune آنیونیک بوجود می‌آید. در اینصورت الکترونهای جذب شده توسط مراکز مشتب خنثی بودن ملکول را تضمین کرده و میتوان این مطالعه را تجدید کرد.

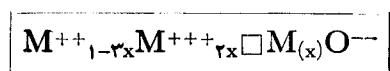
حالات M ۲ - Défauts M ۲

با ملاحظه مدل واگنر غیراستوکیومتری در اثر M lacune بوجود می‌آید در مورد این ترکیبات بارهای مشتب بر روی ایونهای مختلف منتشر شده و باعث تغییر درجه اکسیداسیون میشوند و این بارهای همیشه دروضع ثابتی نبوده و از یک اتم با تم دیگر منتقل میگردند که خود معرف یک حفره مشتب در باند والانس (B.V.) میباشد که علت هدایت الکتریکی میباشد.

این ترکیبات دارای دونوع کاتیون میباشند و فرمول عمومی آنها چنین است :



در صورتیکه x انحراف از استوکیومتری باشد فرمول جسم چنین است :



و تعادل زیر بین اجزاء آن موجود میباشد :



و بطبق قانون اثر جرم :

$$k_1 = pO_2^{-r} \times [\square M][h^+]^r$$

وچون :

$$[h^+] = 2[\square M]$$

میباشد درنتیجه :

$$[h^+] = kpO_2^{1/r}$$

و برای یک اکسید معمولی M_nO_m هدایت الکتریکی خیلی است.

$$\sigma = A' p O_2^{+r}$$

و بنابراین مقاومت الکتریکی چنین اکسیدی با نسبت pO_2^{-r} (در مورد اکسیدهای $MO_{n-1/m}O$) تغییر کرده و منحنی حاصل دارای شیب منفی میگردد. جسم حاصل نیمه هادی (S.C) از نوع مشبت (p) میباشد. برای این اجسام ثابت هال Hall بزرگتر از صفر میباشد.

تبصره :

ممکن است اکسیدهای فوق در اثر مقدار اضافی آنیون بوجود بیانند دراینضور آنیونهای اضافی با حفره های مشبت همراه خواهند بود.

مطالعات تجربی در مورد هدایت الکتریکی اکسیدها :

اساس مطالعه بر مبنای تغییرات هدایت الکتریکی نسبت به فشار نسبی اکسیژن انجام گرفته است و معمولاً این تغییرات در دمای ثابت (isotherme) بمنظور دو هدف انجام میگردد.

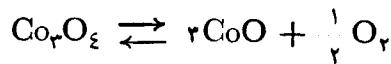
۱- تعیین نوع هدایت

۲- تعیین دامنه ثبات اکسید غیراستوکیومتری با دقت کامل

در مورد تعیین حالت ثبات نسبت به فشار نسبی اکسیژن (pO_2) منحنیهای ایزوکرم رسم شده بر حسب $R=f(pO_2)$ حالت تقاطع مشخصی را هنگام عبور از یک فاز به فاز دیگر نشان میدهد.

روش اندازه گیری :

ممولاً فشار نسبی اکسیژن بوسیله فاز شیمیائی تأمین میگردد مثلاً تعادل تجزیه Co_3O_4 کاملاً شناخته شده است.

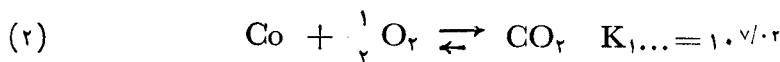
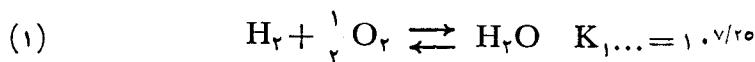


و ثابت تعادل آن :

$$K = p\text{O}_2^{\frac{1}{2}}$$

نیز مشخص می‌باشد و میتوان دستگاه ساده‌ای تهییه کرد که از Co_3O_4 پر شده باشد و آنرا در کوره با دمای ثابتی قرار داد. سپس بطور مداوم فشار نسبی اکسیژن را با داخلی کردن ازت میتوان از یک الی 400°C اتمسفر تغییر داد.

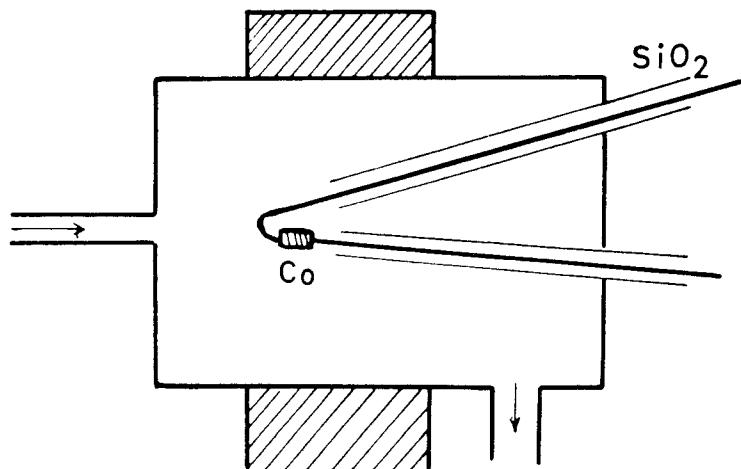
در صورتیکه بخواهند از فشار 400°C اتمسفر پائین‌تر روئد بایستی به تعادلهای دیگری متوجه شوند و در اینمورد معمولاً از مخلوط $\text{N}_2 + \text{H}_2$ و بخار آب و یا $\text{N}_2 + \text{CO} + \text{CO}_2$ استفاده میشود. این فشارها بكمک ترسود یnamیک در 0°C محاسبه شده‌اند.



اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی :

در این اندازه‌گیری بایستی تعادل سریع و کامل بین اکسید مورد مطالعه و اتمسفر خارجی برقرار شود و ساده‌ترین روش اندازه‌گیری ۵ بروی یک میله پلی کریستالی میباشد. مشکل عمل پیدا کردن سیم فلزات با درجه خلوص خیلی زیاد و اندازه مناسب میباشد.

اکسید‌هاییکه بدین طریق مورد مطالعه قرار گرفته‌اند عبارتند از :

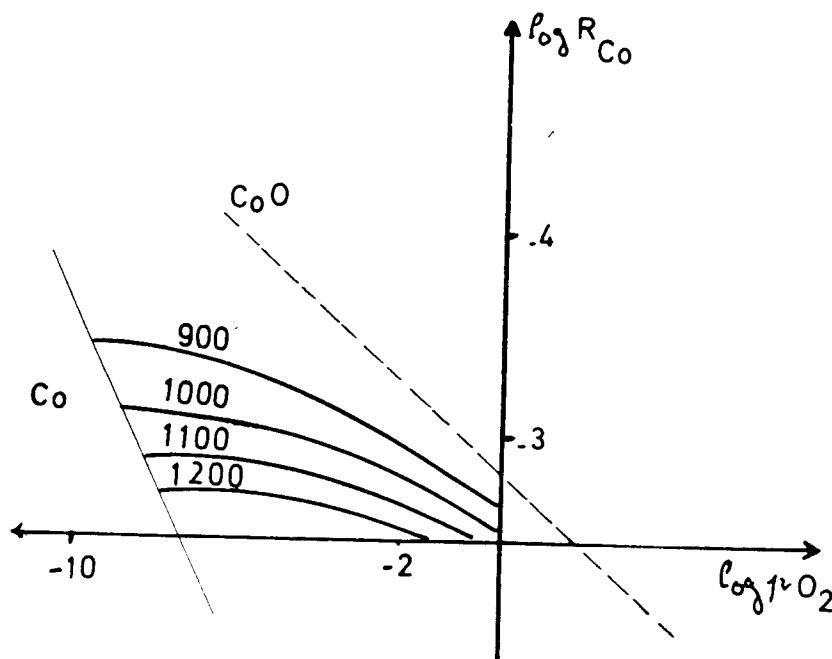


شکل ۲ - کوره الکتریکی با تنظیم خودکار

دستگاه اندازه‌گیری تشکیل شده است از یک لوله آزمایشگاهی این لوله بلوله دیگری که از SiO_2 می‌باشد متصل می‌گردد. در داخل این دو لوله عایق دوسیم پلاتین که هادی می‌باشند قرار دارد و بوسیله پیچش این سیم‌ها به فلز موردنظر اتصال دارند (در شکل Co کبالت به مفتول پلاتین متصل شده) این لوله در داخل یک کوره الکتریکی که دارای تنظیم خودکار می‌باشد قرار داشته و درجه حرارت بوسیله کوپل پلاتین - پلاتین رودیه تا 100°C تقریب اندازه‌گیری می‌شود.

اکسیداسیون سیم CoO به Co بوسیله مقاومت الکتریکی آن مشخص می‌گردد. این مقاومت تا زمانی که فلز اکسید نشده ضعیف می‌باشد و بتدریج که اکسید می‌گردد مقاومت زیادتر می‌گردد و پس از آنکه کاملاً اکسید شد ثابت می‌گردد. اندازه‌گیری مقاومت میتواند بوسیله جریان دائم یا متناوب انجام شود. رابطه $R_{\text{Co}} = f(p\text{O}_2)$ نقطه بنقطه با اندازه‌گیری مقاومت اکسید کبالت در حال تعادل با فشار نسبی اکسیژن انجام می‌گیرد.

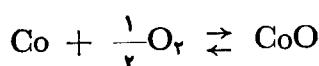
در مورد اکسید کبالت CoO و برای درجات حرارت 900°C , 1000°C , 1100°C و 1200°C درجه سانتیگراد دسته منحنی زیر بدست آمده است.

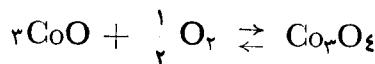


شکل ۲

۱- تعیین دامنه وجود اکسید کبالت غیراستوکیومتری :

این منحنیها که از 900°C بدست می‌آیند تمام دامنه وجود CoO را می‌پوشانند حد فشار جزئی اکسیژن $p\text{O}_2$ بوسیله دو تعادل زیر شناخته شده است.





با استفاده از این روش دامنه وجود فاز غیراستوکیومتریک مشخص میگردد.

- شیب منفی این منحنیها تأیید میکند که اکسید کبات یک نیمه هادی از نوع مشبت (p) میباشد بنابراین برطبق این روش نیمه هادیها قابل اندازه گیری بوده و نوع آنها مشخص میگردد.
تغییرات این منحنیها شامل قانون ذیل است:

$$\log R_{\text{Co}} = a \log p\text{O}_2 + b (\log p\text{O}_2)^2 + C$$

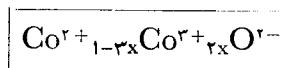
و a دومقدار مشخص میباشد که با درجه حرارت تغییر میکند. Log R = C برای فشار اکسیژن مساوی یک اتمسفر است و تابعی از روش آزمایش بوده و با عاد سیم مربوط میباشد.
برای فشارهای کوچکتر از 10° اتمسفر دو قاعده قابل صرفنظر کردن میباشد و از آنجا:

$$\log R_{\text{CoO}} = A(p\text{O}_2)^n$$

مقدار n برای درجات حرارت 1200° تا 900° چنین است.

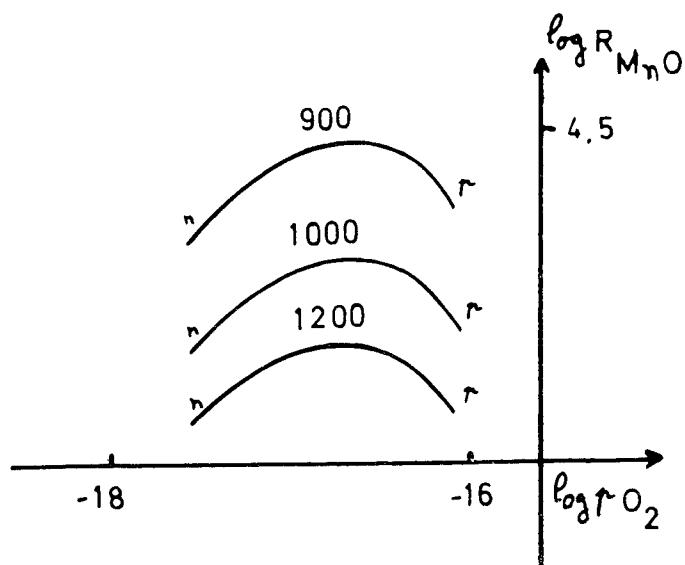
$$\left. \begin{array}{l} n_{1200} = -0.26 \\ n_{900} = -0.27 \end{array} \right\} \rightarrow R_{\text{CoO}} = Ap\text{O}_2^{-\frac{1}{4}}$$

این روش اجازه اندازه گیری فشار جزئی اکسیژن را نیز میدهد و کافی است که سیمی از اکسید کبات CaO در مخلوط مورد آزمایش قرار گرفته و مقاومت آن مشخص گردد.
فرمول معروفی شده برای اکسید کبات چنین است:



منحنیهای ایزوترم برای اکسیدهای NiO و Cu_2O مشابه اکسید کبات میباشند و نیمه هادیهای از نوع مشبت میباشند.

برای اکسیدهایی که بصورت پودر میباشند آنها را بر روی سوپرتی از خمیر گلوسید با عاد 30×8 میلیمتر آورده و سپس توسط یک سیم پلاتین که بوسیله سیلیس عایق شده است بجریان برق متصل میگردد روش کار اینست که پودرا کسید را در لابلای طبقات خمیر گلوسید نهاده ابتدا آنرا در 1200° درجه بمالیمت حرارت میدهدند تا خشک شود و سپس حرارت را به 900° درجه رسانیده و توسط frittage گلوسید را میسوزانند ضمناً مقاومت را کنترل میکنند. این عمل را در فشار اکسیژن مناسب انجام میدهند و نبایستی محیط احیاء کننده باشد و قیکه مقاومت ثابت گردید عمل فریتاژ تمام شده و اکسید آمده اندازه گیری میباشد.
مطالعه اکسید منگنز (MnO) که از احیای اکسالات منگنز ($\text{C}_2\text{O}_4\text{Mn}$) توسط ظیدریز در اثر تکلیس بدست آمده باشد نتایج قابل توجهی داده است. فشار اکسیژن در مخلوطی از بخار $\text{H}_2 + \text{H}_2\text{O}$ بررسی شده و نتیجه حاصل چنین است.



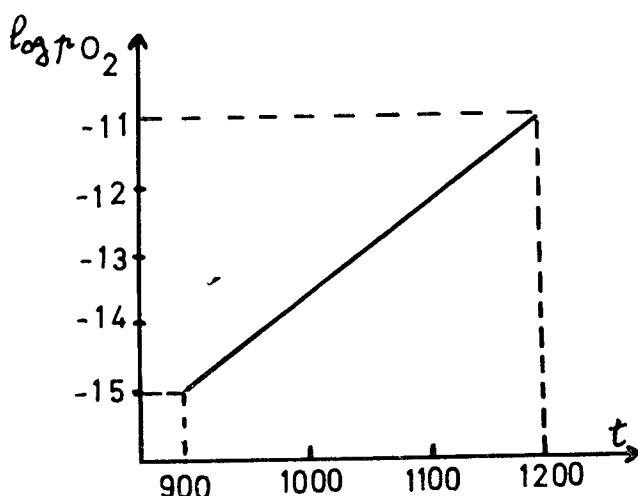
شکل ۴

بطوریکه از منحنی پیداست بر حسب pO_2 میتوان نیمه هادی اکسید منگنز از نوع مشت و یامنفی بدست آورد.

موقعی که مقاومت اکسید زیاد شود در ابتدا نیمه هادی از نوع (n) منفی میباشد این مقاومت به ماکزیممی رسیده و سپس با اضافه شدن pO_2 مقاومت کم شده و نیمه هادی از نوع p بدست می آید. برای هر درجه حرارتی میتوان با استفاده از قانون ذیل میزان تعادل بین دونوع اکسید را تعیین نمود.

$$\log pO_2 = 0.016 T - 29.8$$

T بر حسب درجه حرارت مطلق بوده و تغییرات فشار اکسیژن بر حسب درجه حرارت چنین میباشد.



شکل ۵

در مورد MnO بارسم مدل واگنر میتوان نیمه هادی های n و p را بررسی نمود.

برای نوع n — کاتیون اضافی دراثر ادخال Mn وجود داشته و درنتیجه دو الکترون اضافی برای هر کاتیون ادخالی وجود دارد و تغییرات هدایت برحسب فشار اکسیژن چنین است:

$$\sigma = pO_2^{-1/6}$$

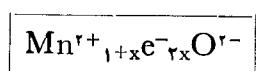
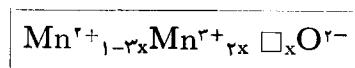
برای نوع p — این نیمه‌هادی در اثر lacune منگنز ($\square Mn$) نتیجه می‌شود و با درنظر گرفتن Mn^{3+} برای هر lacune کاتیونیک دواتم Mn^{3+} بوجود خواهد آمد و تغییرات قانون هدایت الکتریکی مطابق فرمول زیر است:

$$\sigma = (pO_2)^{1/4}$$

در صورتیکه \square را خمثی فرض ننماییم و بصورت $\square Mn^{3+}$ درنظر بگیریم تغییرات فوق چنین خواهد شد:

$$\sigma = (pO_2)^{1/2}$$

فرمولهای دونوع اکسید غیراستوکیومتریک منگنز چنین است:

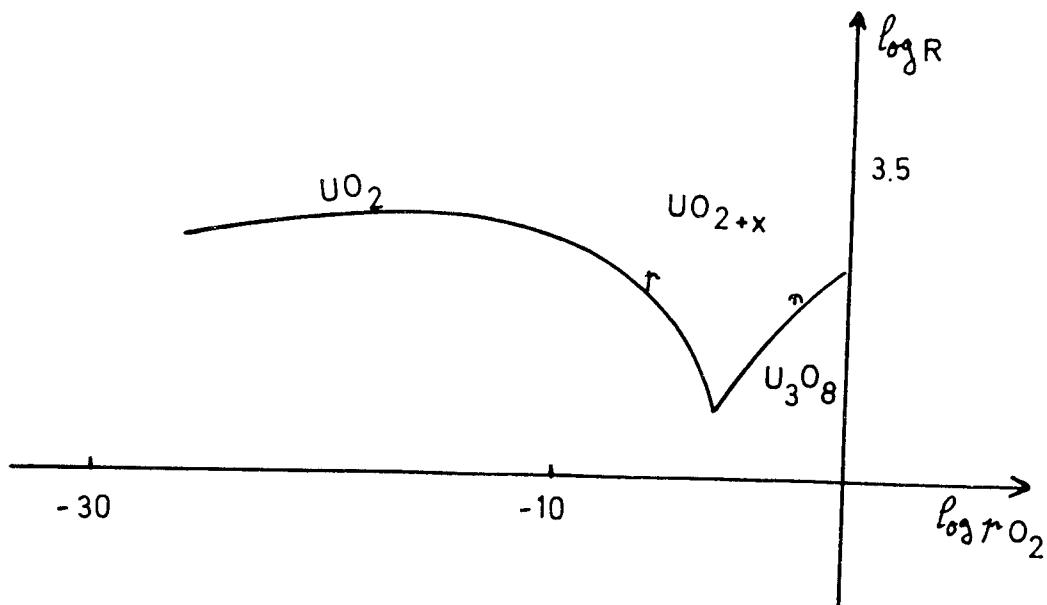


که x انحراف از استوکیومتری می‌باشد.

در مورد بی اکسید اورانیم UO_2 حالت مخصوصی وجود دارد که مشخصه تغییرات فازسیستم می‌باشد.

این اکسید بین ۸۰۰ و ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد مطالعه شده و منحنی ذیل در این فاصله حرارتی

قابل استفاده می‌باشد.



شکل ۶

برای فشار اکسیژن کمتر از 10^{-20} atm مقاومت تغییر نمی‌کند و اکسید دارای فرمول استوکیومتریک می‌باشد.

این منحنی اجازه شناسائی دامنه وجود اکسیدهای غیراستوکیومتریک و نوع نیمه‌هادی‌های حاصل و همچنین اکسید استوکیومتریک را می‌دهد.

بعضی از ترکیبات غیراستوکیومتری که نیمه‌هادی‌ها را تشکیل می‌دهند در تهیه ترانزیستورها نقش اساسی را داشته و مصارف صنعتی آنها روزافزون می‌باشد.

همچنین در بین ترکیبات غیراستوکیومتریک برنزهای تنگستن را باید نام برد که دارای مصارف صنعتی قابل توجه می‌باشد.

منابع استفاده

بطوریکه در شماره قبل اشاره شد منابع استفاده چنین است :

۱- چهار جلد کتاب 2nd. London. Arnold—A.H. Cottrell

۲- گزارش کنفرانس‌های کنگره بین‌المللی شیمی سال ۱۹۶۳، چاپ امریکا

۳- یادداشت‌های آقایان پروفسور Colong و پروفسور Frondish استادان محترم دانشکده علوم

پاریس درخصوص شیمی جامدات.